

用于超纯试剂储存与痕量分析的高纯度半导体级Pfa取样瓶

货号: PL-CP194



简介

专为半导体级试剂储存和痕量分析设计的高纯度PFA取样瓶。这种惰性容器可防止金属离子浸出与污染，为关键工业实验室流程和超纯流体处理确保基线稳定性与数据可重复性。欢迎即刻联系我们。

[了解更多](#)

应用场景	说明	核心优势
半导体制造	储存和运输晶圆加工所用的超高纯度 (UHP) 化学品和光刻胶	预防痕量金属污染导致晶圆缺陷
痕量元素分析	盛放环境或地质研究中用于ICP-MS、ICP-OES和AAS的样品和标准品	确保超低背景水平和高数据可重复性
催化剂墨水储存	存放含有异丙醇、Nafion和各类催化剂的浆料，用于电化学测试	光滑内壁避免残留物损失，维持浆料一致性
LC-MS/MS样品制备	储存超纯水、醋酸铵等高纯度溶剂，用于液相色谱分析	防止溶剂渗透以及增塑剂或金属离子浸出
硅浓度检测	样品转移和储存，用于植物组织或工业材料中的痕量硅分析	防止瓶壁硅浸出和样品组分吸附
酸消解流程	储存高腐蚀性消解样品 (如HF、HNO ₃) ，等待稀释和检测	在高温下对无机酸仍具备优异耐受性
标准参考物质	长期归档保存有证参考物质和一级校准标准品	通过防止蒸发和吸附维持浓度稳定性
电池研究	在受控实验室环境中处理电解质组分和特殊添加剂	化学惰性确保不会干扰电化学检测结果

特性	PL-CP194系列规格
材料	高纯度全氟烷基树脂 (PFA)
产品型号	PL-CP194
耐温范围	-200°C 至 +260°C (-328°F 至 +500°F)
耐化学性	通用耐腐 (熔融碱金属、氟气除外)
痕量金属背景	主要元素 < 10 ppt (万亿分之一)
表面张力/润湿性	疏水，表面能极低
标准容量 (示例)	500ml、1000ml (支持全定制)
瓶盖设计	无衬垫高扭矩螺纹瓶盖，实现气密封
制造工艺	精密注塑和/或定制CNC加工
清洁方案	可提供半导体级超纯水/酸清洁选项
尺寸	根据客户要求定制生产